のトラッキングサーボ技術が重要な役割を担う。このようなトラッキングサーボ技術に関しては、例えば、日本応用磁気学会誌、Vol. 20, No. 3, p. 771 (1996)、山口、「磁気ディスク装置の高精度サーボ技術」に詳細な内容が開示されている。この文献によれば、現在のハードディスクドライブでは、ディスクの1周、すなわち36 0度の角度において、一定の角度間隔でトラッキング用サーボ信号、アドレス情報信号、再生クロック信号等が記録された領域を設けている。このような情報信号を予め記録することを、プリフォーマット記録という。磁気へッドは、一定間隔でこれらの信号を再生することにより、ヘッドの位置を確認し、必要に応じて修正しながら正確にトラック上を走査することができる。

【0005】上述のトラッキング用サーボ信号、アドレス情報信号、再生クロック信号等はヘッドが正確にトラック上を走査するための基準信号であるので、その記録に際して、ヘッド位置決め精度が高いことが要求される。例えば、日本応用磁気学会第93回研究会資料、93-5、p. 35 (1996)、植松他、「メカ・サーボ、HDI技術の現状と展望」に記載された内容によれば、現在のハードディスクドライブでは、ディスクをドライブに組み込んだ後、専用のサーボ記録装置を用いて磁気ヘッドを厳密に位置制御しながらプリフォーマット記録を行っている

【0006】このようなサーボ信号、アドレス情報信号、再生クロック信号等のプリフォーマット記録は、近年商品化された大容量フレキシブルディスクまたはディスクカートリッジが着脱可能なリムーバブルハードディスク用媒体についても同様に、専用のサーボ記録装置を用いて行われている。

【0007】このような専用のサーボ記録装置を用いた磁気へッドによるプリフォーマット記録には、以下のような課題があった。第1に、磁気ヘッドによる記録は基本的にヘッドと媒体との相対移動による線記録であるため、専用のサーボ記録装置を用いて磁気ヘッドを厳密に位置制御しながら記録を行う上記の方法では、プリフォーマット記録に多くの時間を要する。さらに、専用のサーボ記録装置がかなり高価である。従って、プリフォーマット記録に要するコストが高くなる。

【0008】この課題は、磁気記録装置のトラック密度が向上するほど深刻になる。ディスク径方向のトラック数が増加することに加えて、以下の理由によってもプリフォーマット記録に要する時間が長くなる。つまり、トラック密度が向上するほどヘッドの位置決めに高精度が要求されるため、ディスクの1周においてトラッキング用サーボ信号等の情報信号を記録するサーボ領域を設ける角度間隔を小さくしなければならない。このため高記録密度の装置ほどディスクにプリフォーマット記録すべき信号量が多くなり、多くの時間を要することになる。

【0009】また、磁気ディスク媒体は小径化の傾向に

あるものの、依然として3 5インチや5インチの大径ディスクに対する需要も多い。ディスクの記録面積が大きいほどプリフォーマット記録すべき信号量が多くなる。このような大径ディスクのコストパフォーマンスに関しても、プリフォーマット記録に要する時間が大きく影響している。

【 O O 1 O 】 従来のプリフォーマット記録における第2の課題は、ヘッド・媒体間のスペーシング、および、記録ヘッドの先端ポール形状に起因して記録磁界が広がるため、プリフォーマット記録されたトラック端部の磁化遷移が急峻性に欠けるという点である。

【0011】磁気ヘッドによる記録は、基本的にヘッドと媒体との相対移動による動的線記録であるため、ヘッド・媒体間のインターフェース性能の観点から、一定量のヘッド・媒体間スペーシングを設けざるを得ない。また、現在の磁気ヘッドは通常、記録と再生を別々に担う2つのエレメントを有する構造上、記録ギャップの前縁側ポール幅が記録トラック幅に相当し、後縁側ポール幅は記録トラック幅の数倍以上に大きくなっている。

【0012】上記の2点は、いずれも、記録トラック端 部における記録磁界の広がりを生じる要因となり、結果 的にプリフォーマット記録されたトラック端部の磁化遷 移が急峻性に欠ける、あるいはトラック端両側に消去領 域を生じるという結果を生ずる。現在のトラッキングサ 一ボ技術では、ヘッドがトラックを外れて走査した際の 再生出力の変化量に基づいてヘッドの位置検出を行って いる。従って、サーボ領域間に記録されたデータ信号を 再生する際のようにヘッドがトラック上を正確に走査し たときのSN比に優れることだけではなく、ヘッドがト ラックを外れて走査したときの再生出力変化量、すなわ ちオフトラック特性が急峻であることが要求される。従 って、上述のようにプリフォーマット記録されたトラッ ク端部の磁化遷移が急峻性に欠けると、今後のサブミク ロントラック記録における正確なトラッキングサーボ技 術の実現が困難になる。

【0013】上記のような磁気ヘッドによるプリフォーマット記録における2つの課題を解決する手段に関しては、既に様々な技術が提案されている。例えば特開昭63-183623号公報には、第1の課題に対する解決策として、磁気転写技術を用いたトラッキングサーボ信号等の複写技術が開示されている。この磁気転写技術を用いれば、プリフォーマット記録の際の生産性が改善されることは事実である。しかしながら、この磁気転写技術は、フレキシブルディスクのように保磁力が比較をあるが、今日のハードディスク媒体のように数百メガビットからギガビットオーダーの面記録密度を担う分解能を備えた高保磁力媒体に対して使用することは不可能である。

【0014】磁気転写技術においては、転写効率を確保

するために、被転写ディスク保磁力の1.5倍程度の振幅の交流パイアス磁界を印加する必要がある。マスターディスクに記録されたマスター情報は磁化パターンあるので、この交流パイアス磁界によってマスター情報の高いはされないようにするためには、マスターディスクの保磁力の3倍程度以上である。現在の高密度ハードディスクの保磁力はでは、現在の高密度の10ギガビットののエルステッドにも達することが予想される。フェリマスターディスクには、現状において4500~7500エルステッド、将来的には9000~12000エルステッドの保磁力が要求されることになる。

【0015】マスターディスクにおいてこのような保磁力を実現することは、磁性材料の選択の面から困難である。さらに、現在の磁気記録技術では、このような高保磁力を有するマスターディスクにマスター情報を記録することができない。従って、磁気転写技術においては、マスターディスクにおいて実現可能な保磁力値を考慮すると、必然的に被転写ディスクの保磁力に制約を受けることになる。

【0016】また、例えば特開平7-153060号公報には、トラッキング用サーボ信号、アドレス情報信号、再生クロック信号等に対応する凹凸形状を有するディスク媒体用基板をスタンパにより形成し、この基板トに磁性層を形成するプリエンボストディスク技術両方に、前述の2つの課題の両方にある。この技術は、前述の2つの課題の両方に表力して有効な解決策となる。しかしながら、ディスクをでは、での当時では媒体とのコンタクト状態)に入るの凹凸形状が記録再生時のヘッドの浮上特性(あるい響を及ぼし、その結果、ヘッド・媒体インターフェースでは接触記録の場合には媒体とのコンタクト状態)に一スを性に問題を生じることが予想される。また、スタンパでもといる基板は基本的にプラスチック基板であるために必要な磁性層成膜時の基板加熱域体性能の確保のために必要な磁性層成膜時の基板加熱ができず、必要な媒体SN比が確保されないという問題もある。

【0017】このように、プリフォーマット記録に関する前述の課題に対して、特開昭63-183623号公報または特開平7-153060号公報に記載された技術は、媒体SN比、インターフェース性能等の他の重要な性能を犠牲にすることとなり、真に有効な解決策とはならない。

【0018】別のプリフォーマット記録技術が特願平8 -191889号の明細書に記載されている。この記録 技術では、基体の表面に情報信号に対応する凹凸形状が 形成され、この凹凸形状の少なくとも凸部の表面が強磁 性材料で形成されているマスター情報担体の表面を、磁 気記録媒体の表面に接触させることにより、マスター情 報担体表面の凹凸形状に対応する磁化パターンを磁気記 録媒体に記録する。

【0019】マスター情報担体の凸部表面を形成する強磁性材料として好ましくは、高飽和磁束密度を有する軟質磁性膜、あるいは基体面内保磁力が40kA/m以下の硬質もしくは半硬質磁性膜を用いる。さらに好ましくは、マスター情報担体表面を磁気記録媒体表面に接触させる際に、マスター情報担体の凸部表面を形成する強磁性材料を励磁するための直流磁界、あるいは磁化パターンの記録を助成するための交流バイアス磁界を印加する。これにより、特開昭63-183623号公報または特開平7-153060号公報に記載された技術に関して先に述べた課題をも解決することができる。

【0020】上記の特願平8-191889号の明細書に記載されている記録技術は、従来の専用のサーボ記録装置を用いた磁気ヘッドによるプリフォーマット記録における課題、あるいは特開昭63-183623号公報または特開平7-153060号公報に開示された技術の課題に関して、以下のような特徴を有している。

【0021】特願平8-191889号の明細書に記載された記録技術では、一方向に磁化されたマスター情報担体表面の凸部の強磁性材料が発生する記録磁界により、マスター情報担体の凹凸形状に対応した磁化パターンが磁気記録媒体に記録される。すなわち、マスター情報担体表面に、トラッキング用サーボ信号、アドレス情報信号、再生クロック信号等に対応する凹凸形状を形成することにより、これらの情報信号のプリフォーマット記録を磁気記録媒体に行うことができる。

【0022】この記録技術では、凹凸形状による磁気抵抗変化に起因して凸部の強磁性材料から生ずる漏れ磁界により記録が行われる。従って、その記録メカニズムは、磁気ヘッドの記録ギャップから生ずる漏れ磁界により記録を行う従来の磁気ヘッドを用いる記録と基本的には同様である。しかし、従来の磁気ヘッドによる記録にあるのに対し、上記の構成による記録はマスター情報担体と媒体との相対移動を伴わない静的な面記録であるということができる。このような特徴により、特願平8-191889号の明細書に記載された記録技術は、プリフォーマット記録に関する前述の課題に対して、以下のように有効な解決策を提供する。

【0023】第1に、この記録技術は面記録であるため、プリフォーマット記録に要する時間が従来の磁気ヘッドによる記録に比べて非常に短い。また、磁気ヘッドを厳密に位置制御しながら記録を行うための高価なサーボ記録装置が不要である。従って、プリフォーマット記録に関する生産性を大幅に向上することができるとともに、生産コストを低減することができる。

【0024】第2に、この記録技術はマスター情報担体 と媒体との相対移動を伴わない静的記録であるため、マ スター情報担体表面と磁気記録媒体表面とを密着させる ことにより、記録時の両者間のスペーシングを最小限にすることができる。さらに、磁気ヘッドによる記録のように、記録ヘッドのポール形状による記録磁界の広がりを生じることもない。このためプリフォーマット記録されたトラック端部の磁化遷移は、従来の磁気ヘッドによる記録に比べて優れた急峻性を有する。その結果、より正確なトラッキングが可能となる。

【0025】また、特願平8-191889号の明細書に記載された記録技術は、特開昭63-183623号公報に開示された磁気転写技術や特開平7-153060号公報に開示されたプリエンボストディスク技術に関して述べたような問題を生じることはない。つまり、プリフォーマット記録される磁気記録媒体の構成や磁気特性に制約を受けることはない。

【0026】例えば、特開昭63-183623号公報 に開示された磁気転写技術において、磁化パターンによ り記録されたマスター情報を備えるマスターディスク は、それ自体が磁気記録媒体であるために相応の磁気記 録媒体分解能を必要とする。このため、マスターディス ク磁性層の磁束密度および膜厚を十分に大きくすること ができず、発生する転写磁界の大きさが非常に小さいも のとなってしまう。またマスター情報は磁化パターンに より記録されているため、ダイビットの突き合わせ磁化 による減磁を生じ、磁化遷移領域における転写磁界勾配 も緩やかである。このような弱い転写磁界によっても十 分な転写効率を確保するために、磁気転写技術において は、被転写ディスク保磁力の 1. 5倍程度もの振幅の交 流バイアス磁界を印加する必要がある。結果的に前述の ように、被転写ディスクの保磁力が制約を受け、記録密 度の比較的低いフレキシブルディスク等にしか使用する ことができなかった。

【0027】これに対して、特願平8-191889号の明細書に記載されたマスター情報担体は、マスター情報を凹凸形状パターンとして有しており、その凹凸形状による磁気抵抗変化に起因して凸部の強磁性材料から生ずる漏れ磁界により記録を行う点が磁気へッドとよる記録媒体としての分解能を必要としないので、マスター情報担体の凸部表面を形成する強磁性材料の磁束密度および体積を従来の磁気へッドと同等の大きな記録界を発生することができる。これにより、通常のフレギが受った。これにより、通常のフレギがであることにより、できるまで、あらゆる磁気に対して十分な記録を発揮することができる。

【0028】また、特開平7-153060号公報に開示されたプリエンボストディスク技術は、前述のようにプリフォーマット記録されるディスク媒体の基板材料と形状に制約を受けるため、媒体成膜時の基板温度に関係

する媒体SN比性能およびヘッドの浮上特性(接触記録の場合は媒体とのコンタクト状態)に関してヘッド・媒体インターフェース性能を犠牲にしていた。これに対し、特願平8-191889号の明細書に記載された記録技術は、上記のようにプリフォーマット記録される磁気記録媒体の基板材料や表面形状においては何らの制約も受けない。

[0029]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、特願平8-191889号の明細書に記載された記録技術は、プリフォーマット記録される磁気記録媒体の構成や磁気特性を問わずに静的な面記録を行うことができる技術を提供するものであり、媒体SN比、インターフェース性能等の他の重要性能を犠牲にすることなく、良好なプリフォーマット記録を効率的に行うことができる優れた技術である。

【0030】しかしながら、この記録技術を真に効果的なものとするためには、マスター情報担体と磁気記録媒体との間に均一な密着性を実現する必要がある。両者間に均一な密着性が実現されない場合は、スペーシングロスに起因して充分な記録信号強度が得られず、従って良好なSN比を確保できないおそれがある。さらに、記録磁界の広がりに起因してトラック端部の磁化遷移が急峻性に欠け、充分なオフトラック特性が得られないおそれがある。

【0031】そこで、本発明は、マスター情報を凹凸形 状パターンとして有するマスタ情報担体を用いて記録媒 体に情報を静的に記録する技術において、マスター情報 担体に対して磁気記録媒体を均一に密着させて、信頼性 の高いプリフォーマット記録を行うことができる手段を 提供することを目的とする。

[0032]

【課題を解決するための手段】本発明によるマスター情報担体の第1の構成は、基体の表面に、情報信号に対応する凹凸形状が形成された領域と、前記凹凸形状が形成されていない領域とが設けられ、前記凹凸形状の少なくとも凸部表面に強磁性薄膜が形成されたマスター情報担体において、前記凹凸形状が形成されていない領域の少なくとも一部分に貫通孔を設けたことを特徴とする。

【0033】また、本発明によるマスター情報担体の第2の構成は、基体の表面に、情報信号に対応する凹凸形状が形成された領域と、前記凹凸形状が形成されていない領域とが設けられ、前記凹凸形状の少なくとも凸部表面に強磁性薄膜が形成されたマスター情報担体において前記凹凸形状が形成されていない領域の少なくとも一部分の表面高さを、前記凹凸形状が形成された領域の表面高さよりも低くしたことを特徴とする。

【0034】このようなマスター情報担体を用いて、強 磁性層を有する磁気記録媒体に前記マスター情報担体の 情報信号を記録するための本発明によるマスター情報磁 気記録装置は、前記マスター情報担体と前記磁気記録媒体とを密着させるための密着手段と、前記マスター情報担体と前記磁気記録媒体との位置合わせを行うための手段と、前記マスター情報担体の凸部表面に形成された前記強磁性薄膜を励磁する磁界を印加するための磁界印加手段とを備えていることを特徴とする。

【0035】本発明によるマスター情報磁気記録装置の第1の具体構成は、前記凹凸形状が形成されていない領域の少なくとも一部分に貫通孔が設けられたマスター情報担体を用い、前記密着手段は、前記マスター情報担体と前記磁気記録媒体とを接触させた状態で、前記マスター情報担体の貫通孔を通して前記マスター情報担体と前記磁気記録媒体との間に存在する気体を排気することにより、前記マスター情報担体の凹凸形状と前記磁気記録媒体とを密着させるように構成されている。

【 0 0 3 6 】本発明によるマスター情報磁気記録装置の第2の具体構成は、前記凹凸形状が形成されていない領域の少なくとも一部分の表面高さを前記凹凸形状が形成された領域の表面高さよりも低くしたマスター情報担体を用い、前記密着手段は、前記マスター情報担体と前記磁気記録媒体とを接触させた状態で、前記マスター情報担体の凹凸形状が形成されていない領域と磁気記録媒体との間に存在する気体を排気することにより、前記マスター情報担体の凹凸形状と前記磁気記録媒体とを密着させるように構成されている。

【0037】上記のような本発明のマスター情報担体およびマスター情報磁気記録装置を用いることにより、マスター情報担体に対して磁気記録媒体を均一に密着させることができ、信頼性の高いプリフォーマット記録を行うことができる。

【0038】また、前記密着手段が、前記マスター情報 担体および前記磁気記録媒体を挟み付ける一対のフランジの周部を互いに締め付ける密 競とを備えていることが好ましい。上記の排気による密 着手段がこの機械的な締め付け手段をも備えることにより、マスター情報担体と磁気記録媒体とのさらに均一な密着が得られる。つまり、通常、中央部に設けられる中央部に集中しやすい吸引力(大気圧)を補うように、周部を機械的に締め付けることにより、マスター情報投体をの展りが抑制され両者が均一に密着報程体とが る。さらに、前記一対のフランジと前記マスター情報担体および前記磁気記録媒体との間の少なくとも一方に弾性部材を介装することにより、マスター情報担体および磁気記録媒体とが一層均一に密着する。

【0039】また、前記マスター情報担体と前記磁気記録媒体との位置合わせを行うための手段として、前記マスター情報担体の内周部または外周部に、前記磁気記録媒体の内周または外周に合わせてマーカーが配置されていることが好ましい。

[0040]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図1から図8を用いて説明する。

(実施の形態1)図3は、マスター情報担体に形成された情報信号を磁気記録媒体に記録するための本発明による装置の第1実施形態を示す断面図である。図中、31a、31bはマスター情報担体、32はハードディスク、33は上フランジ、34は下フランジ、35a,35bは永久磁石、36a,36bは排気装置、37a,37bは三方弁、30はOリングである。永久磁石15a,15bの磁化方向は紙面の裏から表への向きである。

【0041】マスター情報担体31a, 31bの表面に は、例えば図1に示すように、情報信号に対応した微細 な凹凸形状が形成された領域12が、所定の角度間隔で 設けられている。この領域12の一部(図1中の領域 A)を拡大したものを図2に示す。トラッキング用サー ボ信号、クロック信号およびアドレス情報信号のそれぞ れの領域がトラック長さ方向に順番に配置されている。 図2においてハッチングを施してある部分が凸部であ り、凸部表面はCo等の強磁性材料で形成されている。 【0042】このような情報信号に対応した微細な凹凸 形状をマスター情報担体の表面に形成する方法を以下に 説明する。まず、表面粗度が細かく平坦性の良いガラス 基板表面にCo等で構成される強磁性薄膜をスパッタリ ング法により成膜する。次に、例えばフォトリソグラフ ィ法のようなレーザビームまたは電子ビームを用いたリ ソグラフィ技術を用いてレジスト膜を露光、現像した 後、ドライエッチング等によって凹凸形状を形成する。 あるいは基板表面にレジスト膜を形成・パターニングし た後、Co等で構成される強磁性薄膜を成膜してレジス ト膜を除去する、いわゆるリフトオフ法によって凹凸形 状を形成する。

【0043】なお凹凸形状を形成する方法はこれらに限られず、例えばレーザ、電子ビームまたはイオンビームを用いて、あるいは機械加工によって、微細な凹凸形状を直接加工してもよい。また、強磁性薄膜をガラス基板に形成する方法は、スパッタリング法に限らず、真空蒸着法、イオンプレーティング法、CVD法、めっき法等、従来から行われている一般的な薄膜形成方法を用いることができる。

【0044】情報信号に対応した微細な凹凸形状の凸部表面と凹部底面との段差は、マスター情報が記録される磁気記録媒体の表面性およびマスター情報のピットサイズにもよるが、一般的には 0.05μ m以上、好ましくは 0.1μ m以上とする。一実施例において、 0.5μ mとした。

【0045】凹凸形状の凸部表面を形成する強磁性薄膜 材料はCoに限らない。硬質磁性材料、半硬質磁性材 料、軟質磁性材料を問わず、多くの種類の磁性材料を用 いることができる。マスター情報が記録される磁気記録 媒体の種類によらず十分な記録磁界を発生するためには 磁性材料の飽和磁東密度が大きいほどよい。特に200 0エルステッドを超える高保磁力磁気ディスクや磁性層 厚の大きいフレキシブルディスクに対しては、飽和磁束 密度が0.8テスラ以下になると十分な記録が行われな い場合があるので、一般的には0.8テスラ以上、好ま しくは1.0テスラ以上の飽和磁東密度を有する磁性材 料を用いる。

【0046】図1に示すように、マスター情報担体11の情報信号に対応した凹凸形状が形成された領域12以外の領域に貫通孔13が設けられている。貫通孔13は、マスター情報担体の基板がガラスの場合、超音波加工やレーザ加工、ウェットエッチング等の公知の加工方法を用いて形成することができる。貫通孔の径はできるだけ小さく、貫通孔の数はできるだけ多い方が好ましい。一実施例において、超音波加工を用いて直径1mmの貫通孔を3mm四方にひとつの割合で形成した。

【0047】マスター情報担体に形成された情報信号を磁気記録媒体であるハードディスクに記録する際に、マスター情報パターンの中心をハードディスクの中心に合わせてから密着させる必要がある。この位置合わせを容易にするために、図1に示すように、マスター情報担体11の内周部にマーカー14が形成されている。マーカー14は、情報信号に対応した凹凸形状と同時に形成される。このマスター情報担体11の内周部に形成されたマーカー14はハードディスクの内周を位置合わせするように形成されているが、ハードディスクの外間を位置合わせするように、マスター情報担体11の外周部にマーカーを形成してもよい。

【0048】本実施形態において、マスター情報担体に 形成された情報信号を磁気記録媒体であるハードディス クに記録する手順を図3、4および5を用いて説明す る。本実施形態では、大気圧を利用してマスター情報担 体31a、31bとハードディスク32とを全面的かつ 均一に密着させる。マスター情報担体31a,31bと ハードディスク32との間に存在する空気をマスター情 報担体31a, 31bに設けられた貫通孔39を通して 排気することにより、ハードディスク32がマスター情 報担体31a, 31bに押し付けられ、マスター情報担 体31a,31bに形成された凹凸形状パターンの凸部 表面とハードディスク32とが密着する。この後、永久 磁石35a、35bを用いて、マスター情報担体31 a, 31bに形成された凹凸形状パターンの凸部表面の 強磁性薄膜を磁化させることにより、凹凸形状に対応し た情報信号をハードディスク32に記録する。以下に手 順を詳しく述べる。

【0049】まず、図5に示すように、永久磁石52を 用いてハードディスク32を円周方向に沿って矢印51 の方向に予め磁化させておく。なお、永久磁石に代えて 電磁石を用いてもよい。次に図3に示すように、下フランジ34の溝にOリング30を装着し、この上にマスター情報担体31bおよびハードディスク32を重ねる。この際、前述のようにマスター情報パターンの中心とハードディスク32の中心とを合わせるためのマーカー(図1の14)がマスター情報担体31bに設けてあるので、このマーカーをハードディスク32の内周に合わせる。さらにハードディスク32の上にマスター情報担体31a、そしてOリング30を溝に装着した上フランジ33を重ねる。この際も上記と同様に、マスター情報担体31aの内周部に設けられたマーカーをハードディスク32の内周に合わせる。

【0050】上側の三方弁37aを操作して排気装置3 6 aにより、上フランジ33とマスター情報担体31 a との間の空気を吸引する。下側の三方弁376は、下フ ランジ34とマスター情報担体316との空間が大気圧 になるように切り替えておく。マスター情報担体31a とハードディスク32との間の空気がマスター情報担体 3 1 a に設けられた貫通孔39を通して排気されること により、ハードディスク32はマスター情報担体31a に押し付けられ、両者が全面的に密着する。次に図4 (a) に示すように、永久磁石35aを上フランジに平 行に、かつ、排気ダクト38aを中心に回すことによ り、直流励磁磁界41aを印加する。この操作により、 マスター情報担体31aに形成された凹凸形状パターン の凸部表面の強磁性薄膜が磁化され、凹凸形状に対応し た情報信号がハードディスク32に記録される。前述し たように、ハードディスク32は予め永久磁石等を用い て円周方向に沿って初期磁化させておくが、この初期磁 化方向と、情報信号を記録する際に永久磁石35aによ り印加する磁界の方向とは同一であっても逆であっても よい。一実施例では逆方向とした。

【0051】次に、下側の三方弁37bを操作して排気 装置36bにより、下フランジ34とマスター情報担体 3 1 b との間の空気を吸引する。上側の三方弁3 7 a は、上フランジ33とマスター情報担体31aとの空間 が大気圧になるように切り替えておく。マスター情報担 体31bとハードディスク32との間の空気がマスター 情報担体31bに設けられた貫通孔39を通して排気さ れることにより、ハードディスク32はマスター情報担 体31bに押し付けられ、両者が全面的に密着する。 【0052】図4(b)に示すように、永久磁石35b を下フランジ34に平行に、かつ、排気ダクト386を 中心に回すことにより直流励磁磁界41bを印加する。 この操作により、マスター情報担体31bに形成された 凹凸形状パターンの凸部表面の強磁性薄膜が磁化され て、凹凸形状に対応した情報信号がハードディスク32 に記録される。一実施例では、ハードディスク32の初 期磁化方向と、情報信号を記録する際に永久磁石35 b

により印加する磁界の方向とを逆にした。

【0053】以上の手順により、ハードディスク32の両面に短時間でプリフォーマット記録を行うことができる。マスター情報担体に形成された凹凸形状パターンの凸部表面の強磁性薄膜を磁化するのに永久磁石を用いる代わりに、電磁石を用いてもよい。また、永久磁石とマスター情報担体との間に上フランジ33または下フランジ34が介在している状態でマスター情報担体表面の強磁性薄膜を磁化することになるので、上フランジ33および下フランジ34の材質は黄銅鋼等の非磁性材であることが好ましい。

【0054】本実施形態において、磁気記録媒体がハードディスクでなくフレキシブルディスクである場合、マスター情報担体に設けた貫通孔が大きいとフレキシブルディスクが貫通孔に吸い込まれて変形し、プリフォーマット記録が正確な場所に行われなかったり、記録されるうに貫通孔の大きさはできるだけ小さく、かつ、できるだけ多くの貫通孔を設けることが好ましい。このようにすることにより、ハードディスクだけでなくフレキシブィスクにも信頼性の高いプリフォーマット記録を行うことができる。また、本実施形態は、磁気記録媒体の両にでスター情報担体を配置するので、磁気記録媒体の両面に短時間で効率良くプリフォーマット記録を行うことができ、生産性の向上に寄与し得る。

【0055】(実施の形態2)図7は、マスター情報担体に形成された情報信号を磁気記録媒体に記録するための本発明による装置の第2実施形態を示す断面図である。図中、71はマスター情報担体、72はハードディスク、73は上フランジ、74は下フランジ、75は永久磁石、70は弾性板である。また76は排気装置、77は三方弁、78は排気ダクト、79は上フランジ73と下フランジ74を固定するためのボルトである。

【0056】マスター情報担体71の表面には、例えば図6(a)に示すように、情報信号に対応した微細な凹凸形状が形成された領域62が所定の角度間隔で設けられている。この領域に記録される情報信号の具体例は、第1実施形態と同様に図2に示されている。このような凹凸形状は、第1実施形態で説明したように、表面粗度が細かく平坦性の良いガラス基板表面にCo等で構成される強磁性薄膜をスパッタリング法により成膜した後、例えばフォトリソグラフィ法のようなレーザビームまたは電子ビームを用いたリソグラフィ技術を用いてレジスト膜を露光、現像した後ドライエッチング等によって形成される。

【0057】図6に示すように、本実施形態では、マスター情報担体61の情報信号に対応した凹凸形状が形成されている領域62および外周部(図6(a)の白ヌキ部分)の表面高さに比べて、他の領域63(図6(a)のハッチング部分)の表面高さを低くしてある。以下、この領域63を凹部領域という。図6(b)は、図6

(a) における円周方向の一点鎖線AーAに沿う断面を示している。領域62上には、例えば図2に示すような情報信号に対応した凹凸形状が形成されている。この凹凸形状を前述のようにして形成した後、凹部領域63を機械加工、超音波加工、レーザ加工等の公知の加工方法を用いて形成する。凹凸形状が形成された領域62と凹部領域63との段差は、マスター情報担体61の基板の厚さにもよるが数10 μ m以上、好ましくは100 μ m以上とする。

【0058】マスター情報担体61に形成された情報信号を磁気記録媒体であるハードディスクに記録する際に、マスター情報パターンの中心をハードディスクの中心に合わせて密着させる必要がある。本実施形態のマスター情報担体61内周部にも第1実施形態と同様に、図6に示すようなマーカー64が形成され、これによってハードディスクの内周が位置合わせされる。この場合も、マーカーの形成位置はマスター情報担体61内周部に限らず、ハードディスクの外周を位置合わせするように、マスター情報担体61の外周部にマーカーを形成してもよい。

【0059】本実施形態において、マスター情報担体に 形成された情報信号を磁気記録媒体であるハードディス クに記録する手順を図7および8を用いて説明する。本 実施形態では、マスター情報担体71の情報信号に対応 した凹凸形状が形成されている領域とハードディスクフ 2とを大気圧を利用して均一に密着させ、さらにマスタ 一情報担体71とハードディスク72とを機械的に圧接 させる。情報信号に対応した凹凸形状が形成されていな い凹部領域の表面高さを、凹凸形状が形成されている領 域の表面高さよりも低くしておくことによって、マスタ 一情報担体71とハードディスク72との間に空隙がで きる。この空隙の空気を排気することによって、マスタ 一情報担体71の情報信号に対応した凹凸形状が形成さ れている領域とハードディスクフ2とが密着する。この 後、永久磁石75を用いて、マスター情報担体に形成さ れた凹凸形状パターンの凸部表面の強磁性薄膜を磁化さ せることにより、凹凸形状に対応した情報信号をハード ディスクフ2に記録する。以下に手順を詳しく述べる。 【0060】まず、図5に示すように、永久磁石52を 用いてハードディスク72を円周方向に沿って矢印51 の方向に予め磁化させておく。次に、図フに示すよう に、下フランジフ4に弾性板70、ハードディスクフ 2、マスター情報担体71を順番に重ねる。弾性板70 の中央にはハードディスク72と同程度の大きさの貫通 孔が形成されている。マスター情報担体フィをハードデ ィスク72に重ねる際は、前述のマーカー(図6の6 4) をハードディスク72の内周に合わせる。最後にマ スター情報担体71上に弾性板70および上フランジ7 3を重ねる。弾性板70には、シリコンゴム等の弾性を 有する種々の材料を用いることができる。三方弁フフを

操作して、マスター情報担体71の情報信号に対応した 凹凸形状が形成されていない凹部領域と、ハードディス ク72との間の空気を排気装置76により排気する。こ れによって情報信号に対応した凹凸形状が形成されてい る領域とハードディスク72とが密着する。本実施形態 では排気ダクト78が装置の中央に配置してあるため、 マスター情報担体71の中央での排気コンダクタンスが 大きい。従って、ハードディスク72の中央孔からの排 気による負圧がマスター情報担体71の中央部に大きく 作用する一方、外周部にはあまり強く作用せず、その結 果、マスター情報担体71の外周部とハードディスクと の密着性が悪くなる可能性がある。

【0061】そこで、本実施形態では、上フランジ73とマスター情報担体71との間、および、下フランジ74とハードディスク72との間に弾性板70をそれぞれ設け、さらに上フランジ73と下フランジ74とをボルト79を用いて接続している。そして、ボルト79の締め付けトルクを調整することにより、マスター情報担体71とハードディスク72とが適切に圧接されるようにしている。このようにして、マスター情報担体71の情報信号に対応した凹凸形状が形成されている領域とハードディスク72とが均一に密着する。

【0062】最後に図8に示すように、永久磁石75を 上フランジ73に平行に、かつ円周方向に沿って回すこ とにより、直流励磁磁界81を印加する。この操作によ り、マスター情報担体71に形成された情報信号に対応 した凹凸形状の凸部表面の強磁性薄膜が磁化され、凹凸 形状に対応した情報信号がハードディスクフ2に記録さ れる。前述のように、ハードディスクフ2はあらかじめ 永久磁石等を用いて円周方向に初期磁化させておくが、 この初期磁化方向と、情報信号を記録する際に永久磁石 75により印加する磁界の方向とは同一であっても逆で あってもよい。一実施例では逆方向とした。なお、第1 実施形態でも述べたように、永久磁石とマスター情報担 体との間に上フランジフ3が介在している状態でマスタ 一情報担体表面の強磁性薄膜を磁化することになるの で、上フランジ73の材質は黄銅鋼等の非磁性材料であ ることが好ましい。

【0063】上述のように、本実施形態ではマスター情報担体の情報信号に対応した凹凸形状が形成されていない領域の表面高さを、凹凸形状が形成されている領域の表面高さよりも低くすることにより、マスター情報担体とハードディスクとの間に空隙をつくる。そして、この空隙の空気を排気することによって凹凸形状が形成されている領域をハードディスクと密着させる。さらに、マスター情報担体とハードディスクを機械的に圧接させる手段を設けることによって、信頼性の一層高いプリフォーマット記録を可能にしている。

[0064]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、マスター

情報担体の情報信号に対応した凹凸形状が形成されていない領域の少なくとも一部分に貫通孔を設け、この貫通孔からマスター情報担体と磁気記録媒体との間に存在する空気を排気することにより、あるいは、凹凸形状が形成されていない領域の少なくとも一部分の表面高さを、凹凸形状が形成された領域の表面高さよりも低くして、凹凸形状が形成されていない領域と磁気記録媒体との間に存在する気体を排気することにより、マスター情報担体と磁気記録媒体とを均一に密着させ、信頼性の高いプリフォーマット記録を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係るマスター情報担体 の構造を模式的に示す平面図

【図2】図1のA部拡大図であり、マスター情報担体の 表面に形成された情報信号に対応した凹凸形状パターン の一例を示す

【図3】図1のマスター情報担体の情報信号を磁気記録 媒体に記録するマスター情報磁気記録装置の構成を示す 図

【図4】図3のマスター情報磁気記録装置を用いてマスター情報担体の情報信号を磁気記録媒体に記録する方法を示す図

【図5】磁気記録媒体を予め初期磁化する方法の一例を 示す図

【図6】本発明の第2実施形態に係るマスター情報担体 の平面構造および断面構造を模式的に示す図

【図7】図6のマスター情報担体の情報を磁気記録媒体 に記録するマスター情報磁気記録装置の構成を示す図

【図8】図7のマスター情報磁気記録装置を用いてマスター情報担体の情報信号を磁気記録媒体に記録する方法を示す図

【符号の説明】

11.31a.31b,61,71 マスター情報担体 12 62 情報信号に対応した凹凸形状が形成されて いる領域

13,39 貫通孔

14,64 ハードディスク内周位置合わせ用マーカー

32, 72 ハードディスク

33,73 上フランジ

34,74 下フランジ

35a, 35b, 75 永久磁石

36a, 36b, 76 排気装置

37a, 37b, 77 三方弁

30 0リング

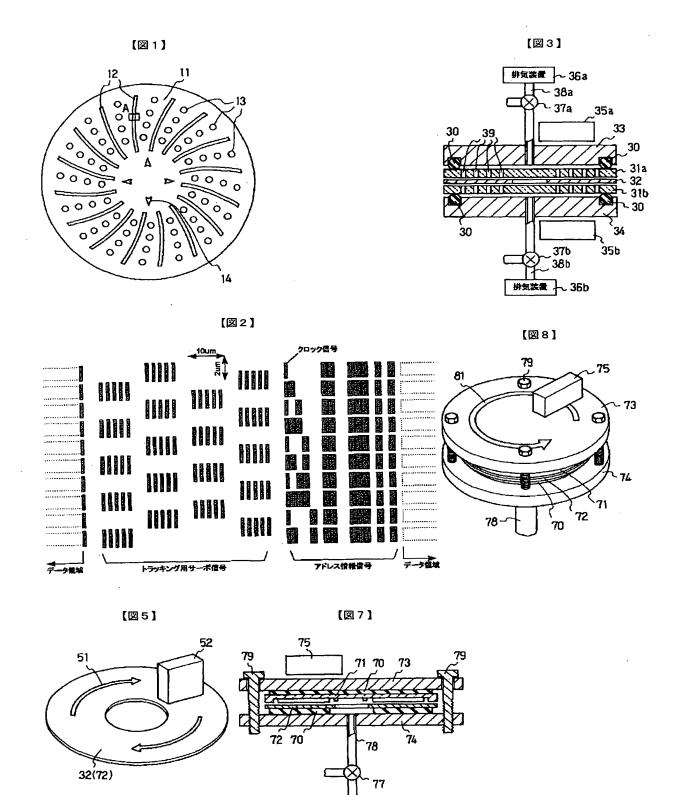
41a, 41b, 81 直流励磁磁界

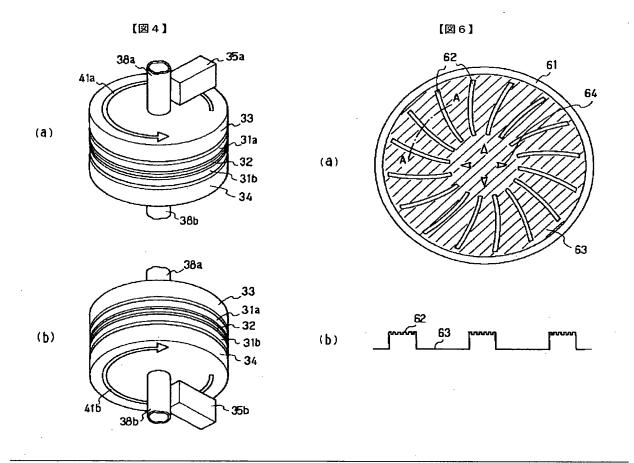
38a, 38b, 78 排気ダクト

63 凹部領域

70 弾性板

79 ボルト





フロントページの続き

(72) 発明者 東間 清和 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72) 発明者 石田 達朗 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成14年7月12日(2002.7.12)

【公開番号】特開平10-269566

【公開日】平成10年10月9日(1998.10.9)

【年通号数】公開特許公報10-2696

【出願番号】特願平9-75703

【国際特許分類第7版】

G11B 5/84

[FI]

G11B 5/84

【提出日】平成14年4月10日(2002.4.10)

Z

【手続補正1】

【手続補正書】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の名称】 マスター情報担体

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体の表面に、強磁性薄膜よりなり、情報信号に対応する凹凸形状パターンが形成された領域と、前記凹凸形状パターンが形成されていない領域とが設けられ、前記凹凸形状パターンが形成されていない領域の少なくとも一部分に貫通孔を設けたことを特徴とするマスター情報担体。

【請求項2】 基体の表面に、強磁性薄膜よりなり、情報信号に対応する凹凸形状パターンが形成された領域と、前記凹凸形状パターンが形成されていない領域とが設けられ、前記凹凸形状パターンが形成されていない領域の少なくとも一部分の表面高さを、前記凹凸形状パターンが形成された領域の表面高さよりも低くしたことを特徴とするマスター情報担体。

【請求項3】 前記マスター情報担体と前記マスター情報担体の情報信号を記録する磁気記録媒体との位置合わせを行うためのマーカーが配置されていることを特徴とする請求項1または2記載のマスター情報担体。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正内容】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、大容量、高記録密度の磁気記録再生装置に用いられる磁気記録媒体へ所定の情報信号を予め記録するために用いられるマスター情報担体に関する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正内容】

[0032]

【課題を解決するための手段】本発明によるマスター情報担体の第1の構成は、基体の表面に、強磁性薄膜よりなり、情報信号に対応する凹凸形状パターンが形成された領域と、前記凹凸形状パターンが形成されていない領域とが設けられ、前記凹凸形状パターンが形成されていない領域の少なくとも一部分に貫通孔を設けたことを特徴とする。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正内容】

【0033】また、本発明によるマスター情報担体の第2の構成は、基体の表面に、強磁性薄膜よりなり、情報信号に対応する凹凸形状パターンが形成された領域と、前記凹凸形状パターンが形成されていない領域とが設けられ、前記凹凸形状パターンが形成されていない領域の少なくとも一部分の表面高さを、前記凹凸形状パターンが形成された領域の表面高さよりも低くしたことを特徴とする。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】削除

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0035

【補正方法】削除

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0036

【補正方法】削除

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0037

【補正方法】変更

【補正内容】

【0037】上記のような本発明のマスター情報担体を 用いることにより、マスター情報担体に対して磁気記録 媒体を均一に密着させることができ、信頼性の高いプリ フォーマット記録を行うことができる。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0038

【補正方法】削除